



News Release

December 4, 2013

Acteon Corporation

Acteon Provides Mechanical Interoperability Verification Services Related To Factory Integration For Global 450mm Consortium At SUNY NanoCollege.

Acteon has agreed to provide to the Global450 Consortium (G450C), headquartered at the SUNY College of Nanoscale Science and Engineering (CNSE) in Albany, New York, mechanical compatibility verification services related to factory integration. As part of the agreement, Acteon provides interoperability verification tool between loadport and semiconductor silicon wafer storage container such as 450mm Multiple Application Carriers (MAC), 450mm Front Opening Unified Pod (FOUP).

G450C is a public-private partnership announced by New York Governor Andrew M. Cuomo in September 2011 to facilitate the 450mm wafer size transition. It is spearheaded by CNSE in partnership with Intel, IBM, GlobalFoundries, Samsung and TSMC. G450C is building the pilot line which enlarged the diameter of the semiconductor silicon wafer to 450mm for the purpose of the productivity improvement of the semiconductor factory now.

The silicon wafer is placed in sealed-up type storing container and transported process to process automatically, but containers can incompletely closed because plural manufacturers produce these storing container and container openers.

This is called compatibility originated open/close issue. This can causes a serious production trouble damaging the semiconductor silicon wafer as well as lowering equipment efficiency.

Acteon provides G450C two models of inspection tool to verify the compatibility of the openers and wafer storing containers. Compiling numerous experiences at conventional 300mm wafer factories, these Acteon tools are designed to measure each characteristics of the wafer storing container and the opener. , The tools help users analyzing and identifying the cause of opening and closing issue, save equipment efficiency as the result.

About G450C: The G450C is a public-private partnership program comprised of New York State (CNSE), Intel, TSMC, Samsung, IBM and GLOBALFOUNDRIES that develops cost-effective test wafer fabrication infrastructure, equipment prototypes and high-volume tools to enable a coordinated industry transition to 450mm wafers. The program uses the capabilities established at CNSE for joint development activities and support of a comprehensive industry ecosystem.

About Acteon: Acteon was established in 2004. Acteon provides products and services to support the automation of semiconductor factory. In addition, Mr. Shoji Komatsu is an Acteon president has awards from the SEMI KAREL URBANEK AWARD in 2010 for contributions for 450mm SEMI standards development. http://www.semiorg/en/Press/CTR_038279



News Release

2013年12月4日

株式会社アクティオン

株式会社アクティオンはニューヨーク州立大学 CNSE にある Global 450mm Consortium(G450C)へ工場統合に関する互換性検証サービスを提供します。

株式会社アクティオン（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長 小松省二）は、次世代半導体工場の自動化に関する機械的な互換性検証サービスを Global 450mm Consortium(G450C)へ提供することに合意しました。G450C との契約の一環として、アクティオンは 450mm Multiple Application Carriers (MAC), 450mm Front Opening Pod (FOUP)などの半導体シリコンウエーハ収納容器とその開閉装置との互換性に関する検証ツールを G450C へ提供します。

G450C は、450mm のウエーハ・サイズ移行を容易にするために 2011 年 9 月にニューヨーク知事アンドリュー M.クオモによって発表された官民共同の合資会社です。それは、インテル、IBM、GlobalFoundries、サムスンと TSMC と協力して CNSE によって先導されます。

G450C は、今、半導体工場の生産性改善の目的で 450mm まで半導体シリコンウエーハの直径を大きくしたパイロットラインを造っています。

半導体用シリコンウエーハは密閉型の収納容器に入れられプロセス工程間を自動搬送されますが、この密閉型収納容器と容器開閉機はそれぞれ異なる複数の会社が製造しているため、開閉トラブル(うまく開かない、うまく閉まらない)が発生することがあります。これを互換性起因の開閉トラブルと呼んでいますが、これは装置稼働率の低下だけではなく半導体シリコンウエーハの破損にも繋がる重大なトラブルとなります。

今回、アクティオンが G450C に提供する半導体シリコンウエーハ収納容器とその開閉装置との互換性に関する検証ツールは、これまでの 300mm ウエーハ工場での経験を反映しウエーハ収納容器と開閉装置の特性を個別に測定可能となっており、開閉トラブル原因の切り分けと各製品の性能向上に効果を発揮するものと期待しています。

G450C(Global 450mm Consortium)について：

G450C は、450mm ウエーハへの連携された業界移行を可能にするために費用効果がよいテスト・ウエーハ製造インフラやプロトタイプ装置、量産用ツールを開発するニューヨーク州 (CNSE)、インテル、TSMC、サムスン、IBM と GLOBALFOUNDRIES から成る官民共同プログラムです。

このプログラムは、包括的な業界エコシステムの共同開発活動と支持のために CNSE で設けられる能力を使用します。

株式会社アクティオンについて：

株式会社アクティオン(神奈川県藤沢市)は、半導体工場の製造ラインの自動化に関する技術支援を目的とし 2004 年に創立されました。

また、代表である小松省二は 2010 年に 450mm ウエーハ関連の SEMI における標準化活動への貢献を評価され、SEMI スタンドアードにおける最高栄誉賞である「カレル・アーバネック記念賞(The Karel Urbanek Memorial Award)」を受賞しています。http://www.semi.org/jp/News/Releases/CTR_038503